



走査電子顕微鏡用試料作成に最適

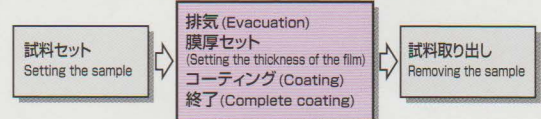
Highly suitable for fabricating samples to be observed using a scanning electron microscope

FULL AUTOMATIC ION SPUTTER

<Features>

- 走査電子顕微鏡用試料作成に最適
Suitable for fabricating samples for SEM
- 排気操作完全自動式
Fully automatic vacuum system
- 膜厚制御連動式
Interlocking system of coating film thickness
- デバイスの電極膜付けにも使用可能
Able to use as an electrode film coater for a device

全自動 / Fully Automatic



DESK TOP QUICK AUTO COATER

SC-701AT

SC-701AT 仕様 (SPECIFICATIONS)

ターゲットサイズ	49mm dia./ Au×1
試料サイズ	70mm dia. (高さ調節範囲 - 15, 20, 60mm)
排気操作	全自動
スパッタ方式	DCスパッタ/平行平板型
膜厚設定方式	オートプリセット方式 (デジタル表示膜厚モニター付)
高圧電源	1kV / 0~20mA
到達圧力	10Pa
チャンバーサイズ	120 (dia.)×120 (depth) mm (ステンレス製)
タイマー	0~15min 連続
ガス導入機構	ニードルバルブ
排気装置	直結型ロータリーポンプ 20L/min (自動リーク付)
設置電源	単相 AC100V 50/60Hz 10A
寸法・重量	本体 : 225 (W)×420 (D)×320 (H) mm, 15kg R P : 300 (W)×160 (D)×200 (H) mm, 9kg

※本仕様は、性能改善のため予告なしに変更されることがあります。

Standard target	49mm dia./ Au×1 (for coating)
Sample base	70mm dia. (Height adjustment range - 15, 20, 60mm)
Evacuation operation	Fully automatic
Sputtering system	DC Sputtering / Parallel-plate type
Film thickness setting	Auto preset (with digital-readout thickness monitor)
High voltage power supply	1kV / 0~20mA
Degree of vacuum	10Pa
Chamber size	120 (dia.)×120 (depth) mm (made of stainless steel)
Timer	0~15min continuous
Gas regulating mechanism	Needle valve
Rotary pump	Directly-connected rotary pump 20L/min (with automatic leaking system)
Power supply	Single phase AC100V 50/60Hz 10A
Dimensions and weight	Main unit : 225 (W)×420 (D)×320 (H) mm, 15kg R P : 300 (W)×160 (D)×200 (H) mm, 9kg

※These specifications may be changed without prior notice for the sake of improvement.

営業品目 / Lines of Business

■真空応用機器

- スパッタ装置
Desk Top Quick Coater (2~8インチ用)
RF/DCスパッタ装置
- 真空蒸着装置
抵抗加熱タイプ
EBタイプ
- 真空排気装置

■電子顕微鏡関連機器

- 電子線描画用パターン発生装置
- SEM用特殊ステージ
試料加熱/引張試験ステージ
描画用モーターステージ etc.
- SEM/TEM用マニピュレータ
- 3次元計測装置
- 立体画像観察装置 3D-SEM®
- 高精細画像取込装置

■その他、各種関連機器の試作・開発・製造・販売

■Vacuum applied equipment

- Sputter coater
Desk Top Quick Coater (2~8inch)
RF/DC Sputtering equipment
- Vacuum evaporation equipment
Thermal resistance type
Electron beam type
- Vacuum pumping down equipment

■Electron microscopic equipment

- Pattern generator for EB lithography
- Special stage for SEM
Heating & tensile testing stage
Motor stage for EB lithography etc.
- Manipulator for SEM/TEM
- 3 dimensional measurement device
- Stereo image observation device 3D-SEM®
- High resolution image capturing system

■Prototyping, development, manufacturing and sales of a variety of related equipment

R100

このカタログは古紙配合率100%再生紙を使用しています。

PRINTED WITH SOYINK

このカタログは大豆油インキで印刷しています。

サンヨー電子株式会社

〒169-0073 東京都新宿区百人町1-22-6
TEL.03-3363-3551 FAX.03-3364-2892
URL : <http://www.sanyu-electron.co.jp>

SANYU ELECTRON CO., LTD.

1-22-6, HYAKUNIN-CHO, SHINJUKU-KU, TOKYO, 169-0073, JAPAN
TEL.81-3-3363-3551 FAX.81-3-3364-2892
URL : <http://www.sanyu-electron.co.jp>